



超小型のセンサおよびアクチュエータ
機械量マイクロセンサ&アクチュエータ

技術分野分類 2103：マイクロ・ナノデバイス
技術キーワード A：MEMS・NEMS
産業分類 E-28：電子部品・デバイス・電子回路製造業

内容	概要	MEMS 技術を駆使して以下に示すマイクロセンサ・アクチュエータを提案・開発している。①集積化 Si 触覚センサ ②人工繊維を用いたウェアラブルセンサ（触覚センサ、加速度センサ） ③フレキシブルタッチパネル ④音叉型水晶製 AFM プローブ ⑤空調ネットワーク用フレキシブル流量センサ ⑥チューリップ型アクチュエータを用いたマイクロクラッチ
	従来技術・競合技術との比較（優位性）	何れも工学的な技術を掛け合わせることで創出した新規デバイスであり、従来デバイスとは異なった独自性を有している。
	本技術の有用性	有用性ロボットハンドリングシステム／次世代原子間力顕微鏡／次世代インターフェイス／空調ネットワークシステム
関連情報 (図・表・写真等)	<p>ウェアラブルセンサ 人工中空繊維 音叉型水晶製AFMプローブ チューリップ型アクチュエータ フレキシブルタッチパネル</p>	
適用可能製品	有用性ロボットハンドリングシステム／次世代原子間力顕微鏡／次世代インターフェイス／空調ネットワークシステム	
技術 シース 保有者	氏名 所属・役職	式田 光宏 大学院工学研究科 附属マイクロ・ナノメカトロニクス研究センター 准教授
技術 シース 照会先	窓口 TEL/FAX e-mail	名古屋大学 産学官連携推進本部窓口社会連携課 TEL 052-789-5545 FAX 052-788-6146 sangaku@post.jimu.nagoya-u.ac.jp

- 知的財産 特許 第4182228号(2008) フレキシブル流量センサ
特開 2008-170425 感圧シート 特開 2009-168480 流量センサ
■試作品状況 **無** 提示可 提供可

作成日 2012年11月30日